

秋田県産業技術センター

施設・設備リスト

2024.04.01 企画事業部

秋田県産業技術センター 施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術相談・指導、技術者育成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。

当センターは、県内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を次のとおり開放しております。

(1)利用者

どなたでもご利用いただけます。

(2)利用対象施設、設備機器および使用料

施設使用料および設備使用料に記載しているとおりです。

(3)利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4)利用・申し込み方法

あらかじめホームページお問い合わせフォーム、Eメール、又は電話等で、対象設備、利用日時等をご連絡のうえ、当日まで申請手続きをお願いします。使用が可能な場合は、許可証を交付します。

(5)使用方法

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6)支払い方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付ください。

(7)ご利用にあたっての遵守事項

- ①会議室等の使用に際しての机、椅子の準備及び復旧は、使用者の責任において行ってください。
- ②茶器は無償で貸し出しますが、消耗品はお持込いただき、後片付けは使用者の責任において行ってください。
- ③敷地内(駐車場・駐車中のお車の中を含む)は、全面禁煙です。
- ④設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物及び有害物質の持ち込みを禁止します。
- ⑤当センターの施設及び設備機器をき損した場合は、直ちに届出願います。

故意又は過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じますので、ご注意ください。

【申し込み・照会先】

秋田県産業技術センター

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番11

TEL 018-862-3414 (自動音声でご案内いたします)

FAX 018-865-3949

Home page <https://www.aitc.pref.akita.jp>

E-mail soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

施設使用料および設備使用料

1. 開放研究室

(1)本館

区 分	面積[m ²]	室数	使用料(円/月)
開放研究室 A	59	1	71,130
開放研究室 B	46	6	67,890
開放研究室 C	40	2	45,260

(2)高度技術研究館

区 分	面積[m ²]	室数	使用料(円/月)
高機能開放研究室	61.44	5	99, 630

2. 講堂・研修室・会議室・展示室

(1)本館

区分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00~12:00	13:00~17:00	9:00~17:00
講堂	100	3,600	4,800	8,400
研修室B	20	1,110	1,480	2,590
展示室		1,360(1日)		

以下の付属備品は無料で利用できます。施設の使用申請の時に合わせてお申し込みください。

- ・液晶プロジェクタ、スクリーン、ホワイトボード、ワイヤレスマイク

(2) 高度技術研究館

区分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
視聴覚研修室	100	9,900	13,200	23,100
研修室A	24	3,600	4,800	8,400

付属設備

区分	使用単位	使用料(円)	
視聴覚研修室	一式1時間につき	映像装置	2,150
		同時通訳装置	1,620
研修室A		拡声装置	530

3. 設備機器

次頁以降の一覧表をご参照ください。

(注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料となります。

(注2) 付属装置の設備使用料が追加される場合があります。

秋田県産業技術センター設備機器一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
1	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト	H F S S V ・ 1 0 ・ 0	H17	970	熊谷(健)
2	三次元電磁界最適化設計ツール	アンソフト・ジャパン(株)	Optimetrics	H18	110	熊谷(健)
3	電磁界解析用ワークステーション	DELL	PrecisionT5400	H20	110	熊谷(健)
4	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング(株)	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	H28	220	熊谷(健)
5	レーザーカッター	エピログ社	Epilog Mini 24	H29	270	熊谷(健)
6	非接触ジェットディスペンサー	武蔵エンジニアリング(株)	AeroJet	R2	100	熊谷(健)
7	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	H17	110	丹
8	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	H4	440	丹
9	フォトレシーバ	NewFocus	1544-B-50	H22	110	丹
10	電流アナライザ	キーサイト・テクノロジー	C X 3 3 2 4 A	R4	3,500	丹
11	非接触三次元デジタイザー	Steinbichler	COMET	H21	1,990	内田(富)
12	全光束測定システム	オーシャンフォトニクス	OP-FLUX-76-CA	H23	2,410	梁瀬
13	電源ノイズ測定器	(株)TFF(テクトロニクス)	MDo4104-6	H23	250	佐々木(大)
14	精密騒音計	リオン(株)	NL-52	H25	100	内田(勝)
15	総合型金属顕微鏡	オリンパス(株)	DSX500,DSX100	H25	540	内田(富)
16	超高精度三次元測定器	Panasonic	UA3P-300	H20	2,930	久住
17	非接触式フィゾー干渉計	Zygo	GPI XP/D	H19	580	久住
18	4インチ光学原器	Zygo	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	H21	300	久住
19	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	ZYGO	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	H23	140	久住
20	CNC3次元測定機	カールツァイス(株)	P R I S M O 5 H T G - S	H7	470	加藤
21	真円度測定機	ランクテラーホブソン	タリロンド262型	H8	110	加藤
22	CNC3次元測定機用データ処理装置	(株)東京精密	C a l y p s o システム	H18	850	加藤
23	超高倍率3次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	H17	1,680	加藤
24	非接触形状測定顕微鏡	キーエンス	V K - 9 5 0 0	H15	1,030	加藤
25	表面粗さ測定機	(株)東京精密	サ-7143000A-3DF-DX-S	H13	120	加藤
26	高精度CNC画像測定機	(株)ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	H27	800	加藤
27	デジタルマイクロスコープ	オリンパス	D S X 1 0 0 0	R4	700	黒沢(憲)
28	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	PTC社	Pro/ENGINEER Wildfire 4	H10	110	内田(富)
29	3Dプリンターシステム	STRATASAS	FORTUS250mc	H25	1,120	内田(富)
30	3D鋳型積層造形装置	シーメット社	SCM-10	H27	4,950	内田(富)
31	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	Solidworks	H28	500	内田(富)
32	3次元X線CTシステム	(株)東芝	TOSCANER-32300μFD	H28	2,850	内田(富)
33	鋳造CAEシステム	クオリカ	JSCAST	H29	580	内田(富)
34	ハイエンド3Dプリンターシステム	ストラタシス社	J750	R1	8,850	内田(富)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
35	3次元光造形システム	アルテック	Origin One	R5	5,940	内田(富)
36	3D形状計測システム	東京貿易テクノシステム	VMC7000M	R2	3,000	黒沢(憲)
37	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋(株)	KS-1703型	H7	160	遠田
38	管状炉	タナカテック	MPH-6VGS	H15	520	遠田
39	炭化賦活炉	(株)ウエーブ二十一	炭化賦活炉 T-2000L	H16	1,210	遠田
40	ナノバブル評価装置	マイクロトラック・ベル(株)	ZetaView-PMX100SP	H29	410	遠田
41	プラスチックノッチ加工機	東洋精機製作所	A-4	R4	170	野辺
42	空圧落下衝撃試験装置	ボクスイ・ブラウン(株)	SM-110-MP型	H3	110	伊藤(亮)
43	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	H21	1,210	菅原
44	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工(株)	ZEM/PEM-1型	H9	1,410	関根
45	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ(株)	UMS-HL	H10	3,410	関根
46	ナノインデント	米国Hysitron社	Model Triboscope他	H14	3,040	関根
47	熱膨張測定装置	理学電機	Thermo Plus 2	H15	470	関根
48	電界放射走査電子顕微鏡	日立製作所	S-4500	H8	620	菅原
49	S-4500用オートステージ	日立製作所	S-8432型	H12	110	菅原
50	電子プローブマイクロアナライザー	日本電子(株)	JXA-8200ほか	H13	1,680	菅原
51	圧縮成形機	東洋精機(株)	試験用加硫プレス 30ton f	S58	280	工藤(素)
52	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	H19	110	工藤(素)
53	3D射出成形シミュレーションシステム	富士通(株)	CELSIUS W480-NTM	H23	1,150	工藤(素)
54	示差走査熱量計	(株)日立ハイテクサイエンス	X-DSC7000	H23	630	工藤(素)
55	プラスチック万能材料試験機(CFRP用)	インストロン(株)	5967型	H24	940	工藤(素)
56	メルトインテグサ	(株)東洋精機製作所	型式G-01	H25	250	工藤(素)
57	自動プラスチック衝撃試験機	東洋精機製作所	IT	R4	250	野辺
58	電子天秤	ザルトリウス(株)	MC210S	H10	110	工藤(素)
59	電子天秤	ザルトリウス(株)	A200S	H10	100	工藤(素)
60	3次元CAD/CAMシステム	CNC Software	Mastercam他	H19	1,620	小松
61	色彩色差計	日本電色工業(株)	SQ-2000	H12	290	工藤(素)
62	粘弾性測定装置	Anton Paar社	MCR302	H26	1,120	工藤(素)
63	低高抵抗率計システム	(株)三菱アナリック	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	H26	210	野辺
64	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	H28	100	野辺
65	デジタル硬度計	テクロック	GSD-1	H29	100	野辺
66	熱分析装置	(株)リガク	TG-DTA8122 / TMA8311(-S) / TMA8311(-H) / DSC8271 / DSCvesta	R2	1,120	関根
67	フーリエ変換赤外分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Nicolet iS50 / iN10MX	R4	1,240	阿部
68	小型電気炉	(株)セイシン企業	PART-3	H2	260	菅原
69	低温恒温水槽	小松エレクトロニクス	DW-621	H8	110	菅原

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
70	電動式塗工機	(株)小平製作所	YOA-B型	H18	110	菅原
71	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	H21	430	関根
72	超硬製転動ミル用容器	(株)伊藤製作所		H20	110	関根
73	マイクロビッカース硬度計	(株)マツザワ	AMT-X7FS-B	H28	270	関根
74	X線回折装置	リガク	RINT-2500	H9	720	菅原
75	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	iCAP6300 Duo	H23	3,670	工藤(素)
76	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋(株)	RFD240ND	R4	100	工藤(素)
77	スクラッチ試験機	新東科学(株)	TYPE. 22H	H6	400	瀧田
78	微小硬さ試験機	(株)フィッシャー・インストルメンツ	H-100	H14	490	瀧田
79	X線残留応力測定装置	パルステック工業株式会社	m-X360s	R2	750	瀧田
80	ナノインデンテーション試験機	アントンパールジャパン	NHT	R5	1,320	瀧田
81	X線応力測定装置	(株)マックサイエンス	MX P 3 A H P	H7	1,730	黒沢(憲)
82	低温灰化装置	ヤマト化学	PDC-210	H15	680	工藤(素)
83	電気マッフル炉	アドバンテック東洋	FUS612PA	H15	360	工藤(素)
84	ドラフトチャンパー	(株)ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	H27	730	工藤(素)
85	精密旋盤	池具鉄工	D-20型	S47	260	加藤
86	ドリル研削盤	(株)藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
87	圧電型切削動力計	日本キスラー(株)	9257B	H2	680	加藤
88	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	110	加藤
89	直立ボール盤	(株)吉田製作所	YUD600	S47	110	加藤
90	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S46	110	加藤
91	超精密成形形状研削盤	ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	H22	3,670	加藤
92	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシンツール	PSB-350U	H12	280	加藤
93	ワイヤーカット放電加工機	(株)ソディック	AQ360L	H18	1,010	加藤
94	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ(株)	MU-400V II 型	H26	2,740	加藤
95	NCフライス盤	山崎技研	F-352	R3	1,280	加藤
96	細穴放電加工装置	(株)ソディック	K1C	R4	730	関根
97	プラスチック粉碎機	ホーライ	VC3-360	H12	240	工藤(素)
98	エコーチップ硬さ試験機	プロセク社(スイス)	D型	S60	130	内田(富)
99	鑄型焼成雰囲気炉	日新化熱工業(株)	EBS-9(改)	H10	1,310	内田(富)
100	チタン用精密鑄造機	吉田キャスト	YSE-100	H28	1,270	内田(富)
101	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機(株)	CYP-90	R5	500	関根
102	プレス付真空熱処理装置	東京真空(株)	PRESS-VAC-2	H3	580	瀧田
103	レーザ加工装置	レーザライン	LDM3000-60	H29	1,900	瀧田
104	マイクロフォーカスX線装置	日本フィリップス(株)	HOMX-161	H5	1,830	黒沢(憲)
105	交直両用TIG溶接機	(株)ダイヘン	AVP-3000P	H13	740	黒沢(憲)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
106	真空チャンバー	日本精機	φ500×H250mm(内寸)材質:SUS304	H14	280	黒沢(憲)
107	溶接部可視化装置	石川島播磨重工業(株)	ILV型	H12	110	黒沢(憲)
108	冷間等方加圧成形装置	アプライドパワージャパン(株)	CIP-50-2000	H7	310	関根
109	多目的高温炉	富士電波工業	ハイマルチ5000	H8	1,040	関根
110	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業(株)	SPS-2080	H8	5,400	関根
111	高速精密切断装置	平和テクニカ(株)	HS-100GII	H29	300	関根
112	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200II	H22	1,780	瀧田
113	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	110	黒沢(憲)
114	磁気探傷機	(株)島津製作所	PRA-80型	S46	230	黒沢(憲)
115	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	510	黒沢(憲)
116	X線透過検査装置	理学電気工業(株)	300EG-B2L型	S55	1,000	黒沢(憲)
117	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジー・ジャパン(株)	USM35XJE	H23	160	黒沢(憲)
118	双腕型協働ロボット	(株)川田工業	Nextage	R1	810	高橋
119	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア(株)	Marc2014AIT	H26	1,620	大竹
120	協働ロボット遠隔操作システム	ユニバーサルロボット/アスラテック	UR5e/V-Sido Webconnect	R2	540	大竹
121	微小硬度計	明石製作所	MVK-E型	S52	200	内田(富)
122	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田(富)
123	試料研磨琢磨機	ビューラー	イコット4000	H20	720	内田(富)
124	試料研磨琢磨機	丸本	DAP-2	S58	720	内田(富)
125	ビッカース硬度計	(株)アカシ	AVK-C2500	H4	110	黒沢(憲)
126	電解研磨装置	ストルアス社	ポレクトロール	H9	230	黒沢(憲)
127	セラミックス研磨装置	丸本ストラウス(株)	アブラミン	H10	2,670	関根
128	セラミックス自動精密切断機	丸本ストラウス(株)	アキュトム50	H11	400	関根
129	万能材料試験機	Instron	5985	H22	2,460	黒沢(憲)
130	三次元ひずみ解析システム	株式会社レーザー計測	VIC-3D	R3	2,000	黒沢(憲)
131	小型造粒機	日本アイリッヒ(株)	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	H2	200	菅原
132	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28~100bpm	H1	110	菅原
133	中型電気炉	(株)モトヤマ	SH-3045E	H10	900	菅原
134	遊星回転ボールミル	(有)伊藤製作所	LA-PO412	H8	210	関根
135	アトライタ	日本コークス工業(株)	MAISE-X	H25	350	関根
136	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業(株)	FMミキサ、FM10C/I-X型	H26	910	関根
137	真空溶解炉	富士電波工業(株)	FVPM-10型	H7	1,890	内田(富)
138	ニューマブラスター	(株)不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田(富)
139	動的ひずみ解析装置	(株)共和電業	EDX-1500A-16AC	H10	110	内田(富)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
140	発光分析装置	(株) SPECTRO Analytical	SPECTROLAB M	H14	1,310	内田(富)
141	エアブラストマシン	(株) 不二製作所	SGF-3 (A)	R2	500	内田(富)
142	エアブラストマシン	(株) 不二製作所	SGF-3 (A)	R2	500	内田(富)
143	シャルピ衝撃試験機	(株) 島津製作所	30kgm型	S54	140	内田(富)
144	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	H19	700	瀧田
145	スガ摩耗試験機	スガ試験機(株)	NUS-ISO-3型	H1	170	関根
146	摩耗試験機	(株) エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	H9	420	関根
147	ベント式射出成形機	日精樹脂工業(株)	NEX110-IV-12EG φ32ベント式可塑化ユニット	R2	1,780	野辺
148	押出機	(株) テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スク径25φ	H16	1,620	工藤(素)
149	集塵機	アマノ(株)	PIE45	H18	490	工藤(素)
150	樹脂乾燥機	アドバンテック東洋	DRL823WA	H16	220	工藤(素)
151	標準試験片作製金型	日精樹脂工業(株)	FP	R5	830	野辺
152	クリーンベンチ	日本エアーテック株式会社	BCM-843S-S	H16	100	久住
153	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	H13	110	久住
154	平坦度測定装置	(株) ニデック	FT-900(ウェア用)	H25	1,270	久住
155	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	H9	130	丹
156	電界制御装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL20/20B	H10	110	久住
157	小型切削動力計	日本キスラー株式会社	9256C2	H16	500	久住
158	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60-1970	H20	110	久住
159	除振台	明立精機	AYA-1809K4	H21	110	久住
160	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	H14	110	久住
161	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250/オートメット250	H28	160	久住
162	電界砥粒制御用多機能ワイヤーソー	(株) タカトリ	WSD-K2	H30	1,010	久住
163	材料物性評価装置	東陽テクニカ	1260-MAS(ソーラートロン)	H18	700	田口
164	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	H25	100	田口
165	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレットパッカード	33120A	H11	110	久住
166	オシロスコープ	日本ヒューレットパッカード	HP-54645A	H11	110	久住
167	ゼータ電位測定装置	Systemex	Nano Z	H19	340	久住
168	動的光散乱式測定装置	(株) Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	H26	810	久住
169	電源装置	トレックジャパン(株)	MODEL609D-6	H7	190	中村
170	安全キャビネット	エアーテック	BHC-1006IIA/B3	H20	110	中村
171	蛍光顕微鏡	ニコン	E400-RFL1	H15	200	中村
172	CCDカラーカメラ	東京電子	CS5270i-S	H12	110	中村
173	砥粒挙動モニター用レンズ	リテックス	ML-Z07545他	H12	110	中村
174	サーマルサイクラー	Bio-Rad	T100	H27	100	中村

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
175	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	H27	100	中村
176	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	H28	100	中村
177	フローサイトメーター	ベックマン・コールター社	CytoFLEX 3レーザー13カラー	H28	1,220	中村
178	核酸増幅システム	三洋電機バイオメディカ(株)	MD F-192	H17	310	大久保
179	化学発光撮影装置	(株)アトー	LuminoGraph I	R5	100	大久保
180	研磨装置	不二越機械工業	SLM-140	H22	490	久住
181	オシロスコープ	ソニーテクトロニクス	TDS-420A	H5	100	久住
182	片面研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140改	H25	560	久住
183	熱電発電モジュール温度特性評価試験装置	サカタ理化学(株)	MS-010	H24	520	菅原
184	減圧除湿乾燥機	カワタ(株)	DV-30	H26	250	野辺
185	高速引張試験機	島津製作所	HITS-T10	H21	2,410	黒沢(憲)
186	落錘衝撃試験機	INSTRON	9205HV	H21	1,470	黒沢(憲)
187	材料試験高速解析システム	(株)フォトロン	FASTCAM SA-X	H24	800	黒沢(憲)
188	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ	PIE-30SD	H22	780	加藤
189	立形マシニングセンタ	ファナック	α-T14iD	H16	470	加藤
190	複合材硬化成形用オートクレーブ	株式会社 羽生田鉄工所	φ850 x 1500L	H21	1,470	藤嶋
191	複合材料切断機	(株)丸東製作所	AC-300CF	H22	580	藤嶋
192	フラットベット切断機	(株)ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	H25	760	藤嶋
193	複合材料圧縮成形装置	(有)郷製作所	MBO05-GMS	H27	1,410	藤嶋
194	プリント基板加工システム	日本LPKF(株)	Protomat C100HF	H16	460	久住
195	ロボットシミュレーションシステム	(株)シーエムエス	Visual Components 3D Automate	R1	730	大竹
196	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	H27	100	丹
197	直流安定化電源	菊水電子工業(株)	PAT80-100T WITH USB	H27	180	佐々木(大)
198	電子負荷装置	菊水電子(株)	PLZ1004WH	H27	100	佐々木(大)
199	雑音総合評価試験機	(株)ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	H1	890	佐々木(大)
200	低温恒温高湿器	エスペック	PSL-2K	H19	240	佐々木(大)
201	ファストトランジェント/バースト試験機	(株)ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	H26	150	佐々木(大)
202	雷サージ試験システム	(株)ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	H13	110	伊藤(亮)
203	耐候性試験機	岩崎電気(株)	SUV-W161	H25	1,540	伊藤(亮)
204	グローワイヤー試験機	Physics technics Labor	TA03.35 (付属チャンバBT-07)	H25	320	伊藤(亮)
205	静電気試験器	ノイズ研究所	ESS-S3011A	H29	200	伊藤(亮)
206	冷熱衝撃装置	エスペック(株)	TSA-73ES-W	R1	700	伊藤(亮)
207	超低温恒温恒湿器	エスペック	PSL-2J	R5	400	伊藤(亮)
208	衝撃波記録解析装置	Lansmont社	Test Partner TP3-USB	H26	100	伊藤(亮)
209	複合環境試験装置	IMV(株)	EM2502(1250/SA5M)(振動試験機本体) Syn-3HA-40(恒温恒湿槽)	H26	1,720	伊藤(亮)
210	真空乾燥器	EYELA	VOS-450SD	H9	130	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
211	自動研磨装置	ビューラー社	AUTOMET2&ECOMET3	H9	170	遠田
212	スクラバー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業(株)	GNE-1500N	H9	180	遠田
213	発熱量測定装置	(株)島津製作所	CA-4PJ	H10	110	遠田
214	粉塵ドラフト	オリエンタル技研(株)	GNS-1800S	H10	110	遠田
215	排ガス分析装置	(株)島津製作所	GC-17A	H10	120	遠田
216	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	H16	110	遠田
217	GC用熱分解装置	(株)島津製作所	PY-2020iD	H21	520	遠田
218	サイクロンサンプルミル	静岡精機(株)	CSM-F1	H20	110	遠田
219	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	三菱化学(株)	AQF-100	H18	730	遠田
220	ビード作製装置	東京科学(株)	TK-4100型	H16	810	遠田
221	ハンディ型燃焼排ガス分析計	(株)テストー	t350システムXL	H23	130	遠田
222	放射線(α線、β線、γ線)測定器	日立アロカメディカル(株)	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	H23	110	遠田
223	粒度分布測定装置	日機装(株)	MT3300EX2-SDC-H	H25	580	遠田
224	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス(株)	R300SR-H	H26	100	遠田
225	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC 社	ICS-1600	H26	410	遠田
226	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル(株)	BELSORP-max	H26	920	遠田
227	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU665DA	H26	100	遠田
228	CHN元素分析装置	LECO	CHN628	R2	570	遠田
229	ガスクロマトグラフ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8890GC+5977B	R3	1,610	遠田
230	低温恒温恒湿器	タバイエスペック(株)	PL-3SP型	H5	180	遠田
231	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7500 Series ICP-MS	H18	1,680	遠田
232	イオンクロマトグラフ(陰イオン・陽イオン・糖分析システム)	ダイオネクス	ICS-3000+2100型	H22	1,570	遠田
233	吸着性能評価装置	QuantacRome社	ChemBET-3000型	H16	700	遠田
234	バイオシェーカー	タイテック(株)	BR-43FL-MR	H23	110	遠田
235	分子量分布測定装置	(株)島津製作所	ProminenceGPCシステム	H25	390	遠田
236	高感度ガスクロマトグラフ	(株)島津製作所	Tracera	H27	470	遠田
237	波長分散型蛍光X線装置	(株)リガク	ZSX Primus IV	R1	1,170	遠田
238	紫外可視分光光度計	株式会社島津製作所	UV-3600i Plus	R3	420	阿部
239	微粉碎機	中央化工機(株)	MB-1	H9	110	遠田
240	粗粉碎機	三田村理研工業(株)	SR-2	H9	140	遠田
241	凍結粉碎器	日本分析工業	JFC-1500型	H15	300	遠田
242	小型タンデムリング粉碎機	中央化工機商事(株)	TR-LM	H24	110	遠田
243	マスクレス露光装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)	μMLA	R4	890	梁瀬
244	摂動方式誘電率測定システム	キーコム(株)	摂動方式試料穴閉鎖形空洞共振器法比誘電率・誘電正接(εr, tanδ)測定システム	H18	310	千葉
245	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	H17	710	佐々木(信)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
246	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント	V2920A	H21	310	佐々木(信)
247	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス	MSO4104	H20	110	佐々木(信)
248	ソフトウェア品質評価試験システム	株式会社ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	H26	260	佐々木(信)
249	ロックインアンプ	Anfatec Instruments	eLockIn205/2	H25	100	丹
250	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス	P 6 3 3 0 ・ P 5 2 1 0 ・ T C P 2 0 2 S	H14	110	佐々木(大)
251	計測制御ソフトウェア開発システム	National Instruments(株)	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発 システム	H23	110	佐々木(大)
252	プレジジョンパワーアナライザ	横河電機(株)	WT3000	H23	180	佐々木(大)
253	絶縁耐圧試験器	日置電機(株)	3159	H14	110	伊藤(亮)
254	ロックウェル硬さ試験機	(株)アカシ	A T K - F 1 0 0 0	H7	190	内田(富)
255	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン社	EMXplus型(マイクロ波ブリッジ含)	H25	1,830	菅原
256	薄膜・粉末両用型高輝度X線回折装置	リガク	SmartLab9K-INP	H29	2,580	菅原
257	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日本電子(株)	JSM-7900F	H30	5,490	菅原
258	イオンスパッタ装置	日本電子(株)	JUC-5000	H4	2,040	岡田
259	実体顕微鏡	オリンパス	SZH-141	H5	350	岡田
260	光電子分光装置(ESCA)	アルバックファイ	5600MC	H4	17,910	千葉
261	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	H27	770	千葉
262	自動接触角計	協和界面科学	DMo-602	R5	600	阿部
263	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	H17	1,410	山根
264	クリーンブースA	日本エアテック	AER-2000C	H9	110	山根
265	ポータブル型分光測定装置	ARCopix S.A.社	ARCspectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	H26	210	山根
266	モノクロメータ式分光光源	朝日分光(株)	MAX-303+,CMS-100	H27	200	山根
267	偏光カメラ	ビットラン	スロットブレードMC1F10HP付き 、100VAC(日本国内向け)	R4	100	山根
268	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	H22	120	笠松
269	ダイヤラップ研磨システム	マルトー	ML-150P	H5	110	岡田
270	低速切断機	サウスベイテクノロジー	SBT650	H5	110	岡田
271	純水・超純水製造装置	アドバンテック	RFU655DA・RFP543RA	H22	240	田口
272	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-III-5D	H16	110	荒川
273	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	H27	470	伊勢
274	金属顕微鏡	ニコン	XPF-UNRB	H4	960	千葉
275	ハイトゲージ	ハイデンハイン	CERTO-CT60M	H6	430	伊勢
276	静電式バッテリー装置	エンジニアリングシステム(株)	QDX500-V-XC	H25	1,130	伊勢
277	ダイシング・ソー	ディスコ	DAD320	H7	1,470	内田(勝)
278	摩擦摩耗試験機	ブルカー・ジャパン(株)	UMT-TL-BASE	R1	900	関根
279	パッチ式多元スパッタ装置	トッキ	SPM506	H7	3,820	山根
280	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ	RF-MN750	H19	220	山根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
281	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	H17	440	内田(勝)
282	スパッタリング用パルス電源	日本MKS	RPG-50A-00	H17	290	内田(勝)
283	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンIV	H4	1,940	田口
284	クライオコンプレッサー	ブルックス・オートメーション社	8200空冷式	H26	100	田口
285	パッチ式多層スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-540H特	H4	2,570	伊勢
286	パッチ式スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-332H	H6	2,040	伊勢
287	ディスクスパッタ装置	日本真空技術	SSH-4S	H5	12,570	山根
288	空冷インバーターチャラー	オリオン機械(株)	RKE2200B1-V-G2	H25	120	山根
289	冷却水循環装置	オリオン(株)	RKE3750B-V-G2	H28	230	山根
290	工場顕微鏡システム	ニコン	MM-11U	H4	2,990	伊勢
291	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	H15	1,990	伊勢
292	純水・超純水製造装置	日本ミリポア(株)	Milli-Q Integral 10	H21	230	山根
293	超音波洗浄装置	本多電子	W118	H7	450	内田(勝)
294	サンプリングオシロスコープ	レクロイジャパン	9354TM	H7	160	黒澤
295	高速スペクトラムアナライザ	HP	E4401B	H11	280	黒澤
296	高速パルスジェネレータ	HP	HP81110A	H11	240	黒澤
297	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチ	FS725	H17	110	黒澤
298	電波暗室・EMI測定システム	Rohde&Schwars	ESIB26a	H16	9,740	黒澤
299	電波暗室用センサスキャナ	デバイス	DM3423AV1/0	H19	210	黒澤
300	発振器	エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	H19	110	黒澤
301	ロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	H19	110	黒澤
302	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	H20	110	黒澤
303	高利得マイクロ波アンテナ	Electro Metrics	EM-6969	H21	110	黒澤
304	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	Schwarzbeck Mess Elektronik	NNBM8125	H21	110	黒澤
305	CISPR22対応電波吸収体	TDK	IS-030A	H22	110	黒澤
306	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンスジャパン	KEC法測定システム	H22	120	黒澤
307	雑音電力測定システム	(株)東陽テクニカ	MAC600A-AJ, EPS/RFP-AJ	H25	100	黒澤
308	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業(株)	KNW-2208, KNW-441, およびF-51	H25	100	黒澤
309	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	H26	150	黒澤
310	放射・伝導イミュニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 2008対応	H27	1,400	黒澤
311	車載機器放射イミュニティ用アンテナ	東陽テクニカ	イミュニティ試験システム	H29	200	黒澤
312	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー(株)	DSOX6004A	H30	140	黒澤
313	EMS用発振器	ローデ・シュワルツ社	SMB100B	R1	110	黒澤
314	ミリ波帯アンプ付アンテナ	(株)テクノサイエンスジャパン	LB-180400Hほか	R3	100	黒澤
315	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	H26	100	木谷
316	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	H27	250	木谷

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
317	EMIレシーバー	ローデ・シュワルツ社	ESW-26、TEPTO-DV/RE、TEPTO-DV/CE、TEPTO-DV/PE	H30	880	木谷
318	電源周波数磁界イミュニティ試験装置	(株)テクノサイエンスジャパン	IEC61000-4-8対応	R2	190	木谷
319	触針式表面形状測定装置	アルバック	DEKTAK150	H21	250	千葉
320	高分解能走査型プローブ顕微鏡	ブルカージャパン(株)	Dimension Icon	R2	2,000	久住
321	MTF評価装置	トライオプティクス	Image Master HR LP	H21	550	梁瀬
322	金属顕微鏡システム	オリンパス	BH3-MJL	H6	1,520	梁瀬
323	分光エリプソメータ	日本セミラボ(株)	SE2000	H28	1,130	山根
324	分光エリプソメータ用反射率測定モジュール	日本セミラボ(株)	SE-2000用	H30	440	山根
325	MTF評価装置	株式会社エフケー光学研究所	MATRIX-CS	R3	670	笠松
326	ナノ加工用イオンビーム装置	セイコーインスツルメンツ(株)	SMI2050	H14	4,090	伊勢
327	クリーンブースB(H17導入)	日本エアーテック	ECB02-22D5	H17	130	伊勢
328	マイクロスコープ	ハイロックス	KH-7700	H19	230	田口
329	スペクトラムアナライザ	HP	HP4396B	H9	930	荒川
330	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	H5	620	高橋
331	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	H5	340	高橋
332	FFTサーボアナライザ	HP	HP35670A	H7	640	荒川
333	高分解能光ファイバー式変位計	フォトニクス	ATW-01 +ATP-A20	H12	220	高橋
334	高周波連続可変フィルタ(H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H13	110	荒川
335	FFTアナライザー	アジレントテクノロジー	35670A	H17	170	荒川
336	5ch 静電容量変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H17	110	荒川
337	超高分解能光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BH20	H18	110	荒川
338	平面検出型光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BZ	H18	110	荒川
339	FFTアナライザー	小野測器	DS-2100	H19	220	荒川
340	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチュアリングシステムズ(株)	BH20	H20	110	荒川
341	ロジックアナライザ	アジレントテクノロジー(株)	16804A	H20	240	荒川
342	オシロスコープ	アジレントテクノロジー(株)	DSO7104A	H21	110	荒川
343	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチュアリングシステムズ	BH25, BD96-B1400HC特	H21	120	荒川
344	ファンクションジェネレータ(2ch出力)	テクトロニクス株式会社	AFG3252	H21	110	荒川
345	レーザ干渉変位計システム	(株)小野測器	LV-2100	H21	130	荒川
346	除振台	明立精機	MAPS-008A-G1010	H22	270	荒川
347	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	L-trace II	H24	680	荒川
348	レーザドップラ振動計	小野測器	LV-1800	H25	140	荒川
349	振動周波数分析器	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	H25	130	高橋

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
350	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	H26	100	荒川
351	ピコメートル分解能非接触変位計	(株) マグネスケール	BN100	H26	100	荒川
352	高分解能反射型レーサースケール	(株) マグネスケール	BF1,BD-96	H26	100	荒川
353	差動型非接触振動計	小野測器 (株)	LV-1800	H26	150	荒川
354	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー	DSOS104A	H29	230	荒川
355	小型赤外線サーモグラフィ	(株) アピステ	FSV-210L	H30	170	高橋
356	オートコリメータ	ニコン	6B	H18	220	笠松
357	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	H10	110	山根
358	オシロスコープ	AgilentTechnologies	54622A	H12	110	黒澤
359	スペクトラムアナライザ	AgilentTechnologies	E4411B	H12	110	黒澤
360	発振器	HP	HP81110A	H11	240	木谷
361	クリーンブースC(H17導入)	日本エアテック	ACB-352C-特型	H7	130	木谷
362	光学顕微鏡	ニコン	MM-11U	H7	590	木谷
363	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H9	440	木谷
364	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	H11	680	木谷
365	高精度スピンスタンド	協同電子システム	LS1000/500PS- II K	H16	2,510	木谷
366	磁気抵抗測定装置	ハヤマ	MRMS-10K	H20	3,770	黒澤
367	スイッチ・マトリックス	ケースレーインズツルメンツ (株)	4200-UL-LS-12	H21	110	黒澤
368	GPIB直流電源装置	菊水電子	PB×40-5	H5	260	木谷
369	小型旋盤	エムコ社	コンパクト8	H5	590	木谷
370	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	H5	280	木谷
371	静電力発生用高圧電源システム	松定プレジジョン	HAR-30P73.3	H27	100	荒川
372	粘度計	ブルックフィールド社	DV2TCP	H29	100	遠田
373	表面張力計	協和界面科学	DY-500	H29	170	遠田
374	ハイスピードマイクロスコープ	キーエンス	VW-9000	H28	400	笠松
375	一軸面内磁場印加マニュアルプローバ	ハイソル (株)	HMP-400SMS-Entry型	H27	350	千葉
376	ネットワーク・アナライザ・システム	アジレント・テクノロジー (株)	E 8 3 6 4 A	H14	1,260	黒澤
377	インピーダンスアナライザ	キーサイト・テクノロジー	E4991B	R5	1,010	黒澤
378	LCRメータ	HP	HP4284A	H7	610	荒川
379	アンプ付き電流プローブ	ソニーテクトロニクス	AM 5 0 3 S + o p 0 5	H11	110	木谷
380	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	H16	110	木谷
381	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	H5	230	内田(勝)
382	マルチメータ	HP	HP3458A	H5	340	内田(勝)
383	ズーム顕微鏡	ユニオン光学 (株)	DZ2-SH	H9	230	笠松
384	大規模データ処理用並列分散計算クラスターリングシステム	IBM	eServer325	H16	150	黒澤
385	高周波連続可変フィルタ(H11導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H11	180	木谷

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
386	フォトリソグラフ用クリーンオープン	榎本化成	CSO-402BF	H12	160	内田(勝)
387	スピンコータ	ミカサ (株)	MS-A150	H21	140	内田(勝)
388	液晶配向シミュレータ	シンテック (株)	LCD MASTER 3D	H18	190	梁瀬
389	ラビング装置	E.H.C (株)	MR-100	H18	270	梁瀬
390	UV加圧硬化装置	E. H. C	MLP-320G	H19	110	梁瀬
391	アッペ屈折計	アタゴ	DR-M4/1550	H21	110	梁瀬
392	ヘッド観察用顕微鏡セット(ポアスコープ)	オリンパス	G080- 034-090-55	H5	110	梁瀬
393	照明光学系設計システム	Zemax社	OpticStudio Professional版	H27	220	梁瀬
394	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業 (株)	B H S - 7 5 1 - P 型	S62	110	梁瀬
395	高性能LD光源	メレスグリオ	56RCS002/HV	H21	110	梁瀬
396	色彩輝度計	コニカミノルタ	分光フィッティング方式 CS-200	H25	130	梁瀬
397	可視光対応光スペクトラムアナライザー	横河計測	AQ6374-10-L1-D/FC/RFC	R2	340	梁瀬
398	高速カメラ	(株) ディテクト	HAS-D3M	H25	110	笠松